

真空脱ガス炉 SBF-200



真空脱ガス炉SBF-200は電子部品および小型電気機器を真空環境下に置き、接着部や絶縁部およびコイル部を脱ガスし、品質を向上させることを目的として作られた装置です。メインポンプはクライオポンプを採用しておりますので、非常にクリーンな排気が可能です。

真空脱ガス炉 SBF-200 仕様

- 到達圧力 $\times 10^{-5}$ Pa台※常温・無負荷・脱ガス完了時
- 最高温度 200℃
- 昇温時間 120℃迄1時間以内
- 均熱範囲 120℃ \pm 5℃以内・・・真空中
- 炉内寸法 748mmW \times 910mmD \times 783mmH SUS304
- 有効棚寸法 565mmW \times 740mmD \times 35mmH
- 棚数 6段
- 加熱機構 マイクロシースヒーター
- 加熱制御 サイリスタ制御
PID方式温調計 \times 7台
- 真空排気系 油回転ポンプ:1500/1800L/min[50Hz/60Hz]
メカニカルブースターポンプ:8330/10,000L/min[50Hz/60Hz]
クライオポンプ9500L/sec(H₂O)
- 真空計 広帯域真空計
- 操作方法 手動/自動操作可能
- ユーティリティ 電気: AC200V三相12kVA
冷却水: 10L/min以上0.15MPa以上0.2MPa以下25℃以下循環
計装エア: 0.5MPa以上
設置寸法: 2000mmW \times 900mmD \times 1600mmH